



Veranstalter / Organizer



Veranstaltungspartner / Event partner

CiS Workshops 2026

MEMS Workshop: „MEMS-Sensoren im Wandel:
Neue Ansätze für Präzision und Integration“

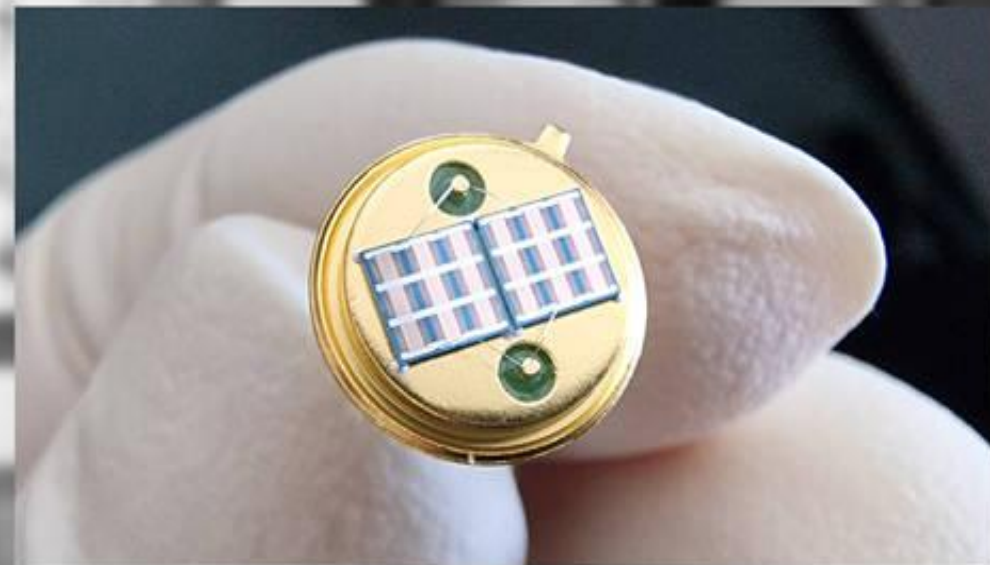
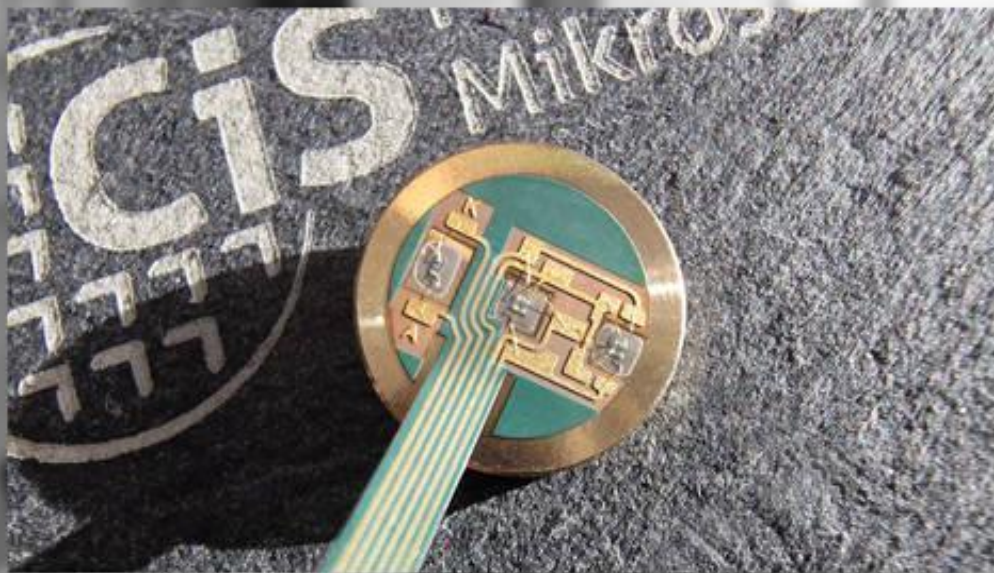
Dienstag, 29. September 2026

MOEMS Workshop: „5. Auflage NDIR-Sensorik:
von der Komponente bis zum System“

Donnerstag, 1. Oktober 2026



SAVE THE DATE



CiS **MEMS** Workshop

Dienstag, 29. September 2026

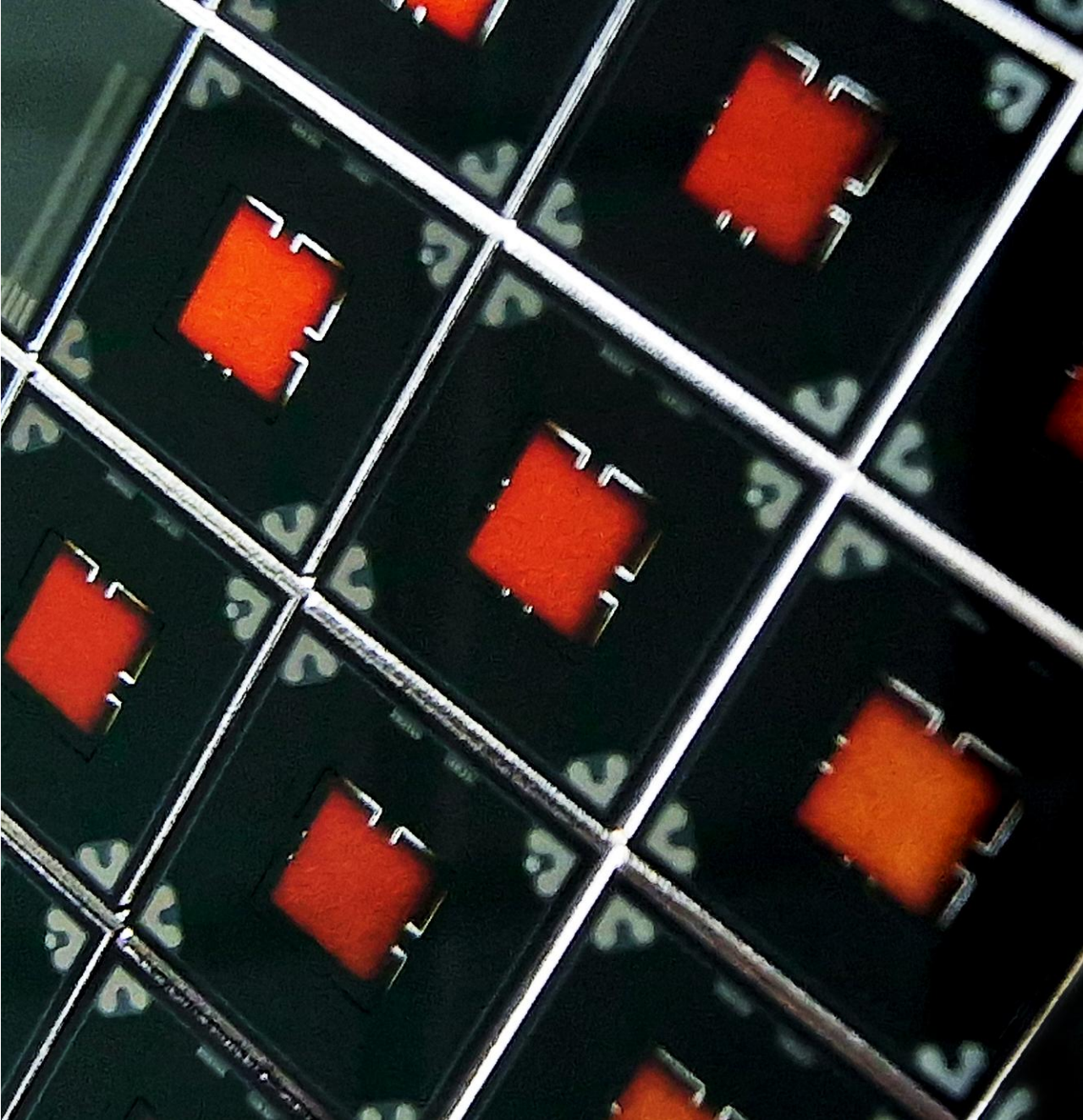
MEMS-Sensoren im Wandel:

Neue Ansätze für Präzision und Integration

CiS **MOEMS** Workshop

Donnerstag, 1. Oktober 2026

*5. Auflage NDIR-Sensorik:
von der Komponente bis zum System*

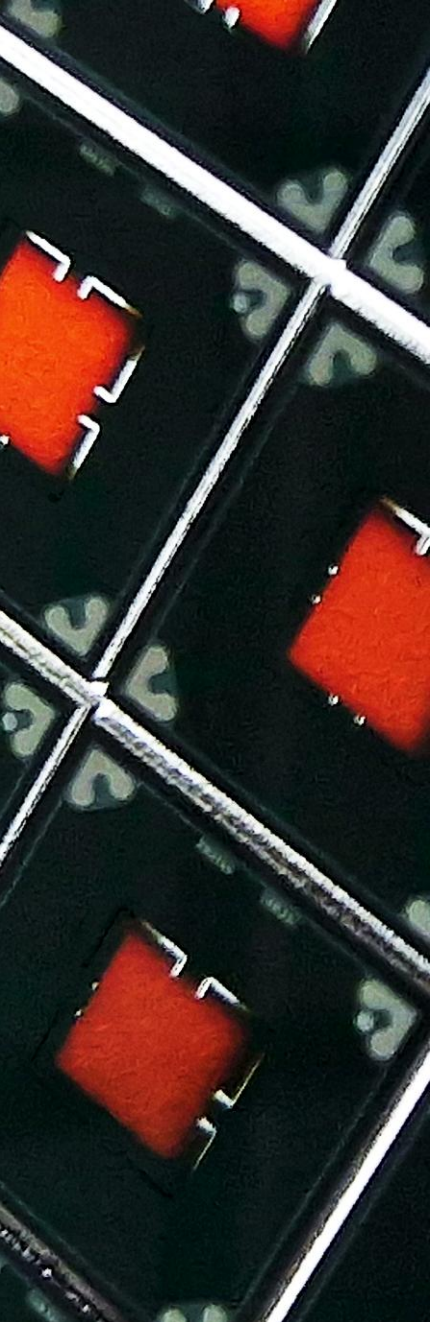


MEMS-Sensoren im Wandel: Neue Ansätze für Präzision und Integration

CiS MEMS Workshop am 29. September 2026

Der diesjährigen CiS MEMS Workshop beleuchtet die komplette Wertschöpfungskette der modernen MEMS-basierten Silizium-Sensorik: von innovativen Sensorelementen über Aufbau und Verbindungstechnik bis hin zur Charakterisierung sowie spezielle Fragestellungen in ausgewählten Anwendungsgebieten.

Der ganztägige Workshop in Erfurt wird vom CiS e.V. ausgerichtet.



CiS MEMS Workshop Agenda I

09:30 **Registrierung & Get Together**

10:00 **Begrüßung**

Olaf Brodersen, Vorstand CiS e.V.

10:15 **Keynote: MEMS-Drucksensoren für die Prozessmesstechnik**

Timo Kober, Endress+Hauser

SESSION I Design, Simulation, Prozesstechnologie + Messtechnik

10:45 **Virtuelles Prototyping: Gekoppelte Multiphysik-Simulation von Silizium-Drucksensoren**

Bernhard Schwartz, CiS Forschungsinstitut

11:10 **Dynamik- und Sensitivitätsbetrachtungen in MEMS-Sensoren für die Rasterkraftmikroskopie**

Prof. Thomas Sattel, TU Ilmenau

11:35 **MITTAGSPAUSE**

12:30 **HF-Dampfätzen zur Opferschichtentfernung: Einflussfaktoren und Prozessstabilität**

Indira Käßlinger, CiS Forschungsinstitut

12:55 **Entwicklung von Diamantspitzen für MEMS-Anwendungen**

Bernd Hähnlein, CiS Forschungsinstitut

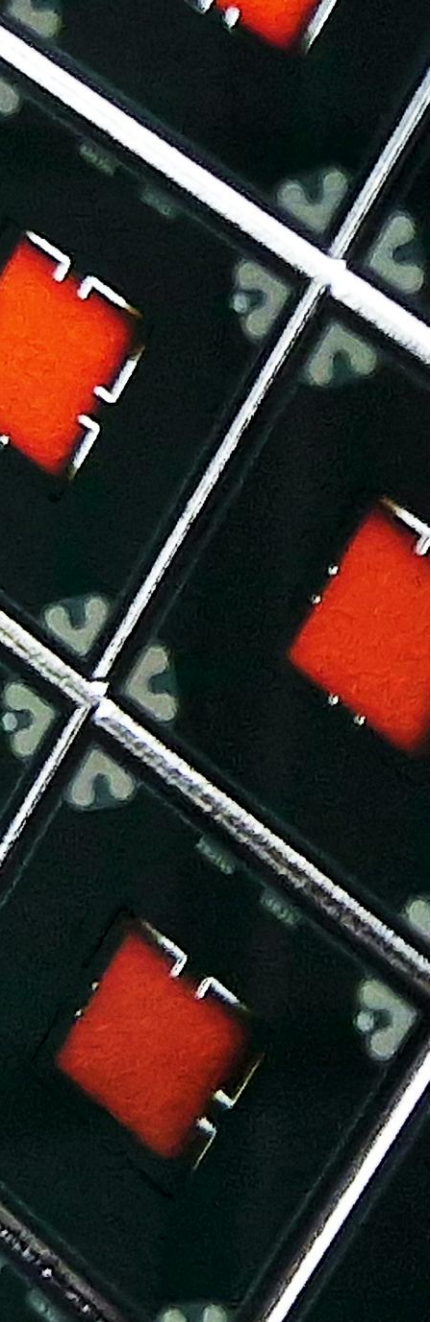
13:20 **MEMS/MOEMS-Wasserstoff-Sensorik für sauerstofffreie Atmosphären und autarke Anwendungen**

Robert Täschner/P. Frenzel, Westsächsische Hochschule Zwickau

13:45 **Analysis of multi-stimuli environmental stress in influences on MEMS inertial measurement units**

Suhas Halathi Dakshina Murthy, TU Ilmenau
(Preisträger Silicon Science Award 2025)

14:10 **KAFFEEPAUSE**



CiS MEMS Workshop Agenda II

SESSION II Applikationen und Märkte

- 14:40 **Fast Steering Mirrors für laserbasierte Satellit zu Satellit Kommunikation im Weltraum**
Tobias Schopf, Micro-Epsilon Messtechnik
- 15:05 **Sensorbasierte Zustands- und Positionsüberwachung von Umformwerkzeugen im Bereich der Innenhochdruckumformung**
Andreas Grundmann, ICM Chemnitz
- 15:30 **Beyond Sensing - Wie drahtlose RFID-Elemente zu autonomen Datenproduzenten werden**
Reinhard Jurisch, microsensys
- 15:55 **Vom fragilen Wafer zur belastbaren Messung - integrierte On-Wafer-Lösungen für die MEMS-Charakterisierung**
Volker Hänsel, ATV Systems GmbH
- 16:20 **Schlussworte und Verabschiedung**
Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut

Allgemeine Informationen zum Workshop

MEMS Workshop: MEMS-Sensoren im Wandel: Neue Ansätze für Präzision und Integration

REGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie sich online auf der Internetseite:

<https://www.cismst.de/workshops/mems-2026/anmeldung/>

Die Anmeldegebühr beträgt 200 € für die Teilnahme vor Ort (umsatzsteuerfrei).

Für eine online-Teilnahme werden 150 € fällig (umsatzsteuerfrei).

Studierende können gegen Vorlage ihres Immatrikulationsausweises kostenfrei online teilnehmen.

VERANSTALTUNGSORT

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik

Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

Sie reisen nach Erfurt ...

...mit **dem Auto** via Autobahn A71 und/oder A4, Ausfahrt Erfurt Ost

...mit **dem Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann Straßenbahn Linie 3

Der Workshop findet im großen Konferenzraum im 3. OG statt.

ORGANISATION

Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

CiS e.V.

Uta Neuhaus
Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

Telefon: +49 361 663 1154

E-Mail: veranstaltung@cismst.de



BEZAHLUNG

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: CiS e.V.

Bank: Sparkasse Mittelthüringen

IBAN: DE37 8205 1000 0130 1134 25

BIC: HELADEF1WEM

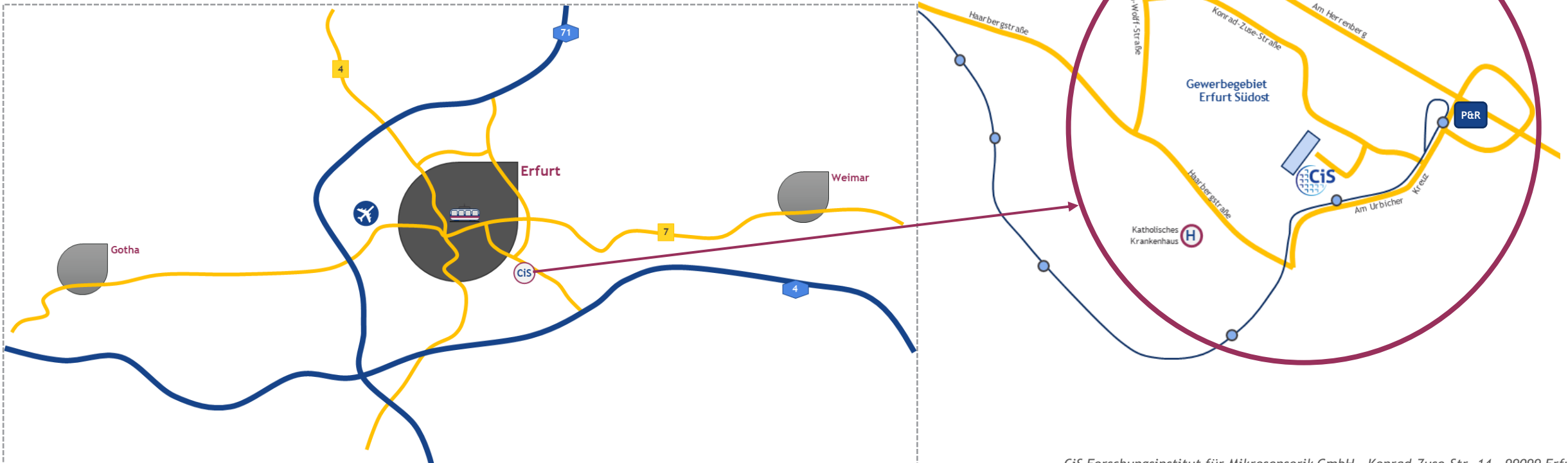
Verwendung: MEMS2026

Straßenbahn Linie 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhausen/ X-Fab" bis zu Fuß bis zum Gebäude des CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH (siehe Foto)



IHRE ANREISE ZUM CIS FORSCHUNGSINSTITUT

Auto	A4 oder A71
Bahn	Hauptbahnhof Erfurt Straßenbahn Linie 3, Windischholzhausen / X-FAB
Flugzeug	Flughafen Erfurt Weimar (ERF)



CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH - Konrad-Zuse-Str. 14 - 99099 Erfurt